ИСПОЛЬЗОВАНИЕ г-АЛГОРИТМА ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ НЕКОТОРЫХ ОПТИЧЕСКИХ МНОГОСЛОЙНЫХ ПОКРЫТИЙ Мица А.В.¹, Стецюк П.И.²

¹Ужгородский национальный университет, Ужгород, Украина, <u>alex.mitsa@gmail.com</u>

²Институт кибернетики им. В.М. Глушкова НАН Украины, Киев, Украина, <u>stetsyuk@d120.icyb.kiev.ua</u>

С помощью r-алгоритма произведено оптимизацию некоторых существующих оптических многослойных покрытий.

Ключевые слова: оптимизация, *r*-алгоритм, оптические многослойные покрытия.

By means of r-algorithm it is made optimisation of some existing optical multilayered coverings.

Keywords: optimisation, r-algorithm, optical multilayered coverings.

Оптические многослойные покрытия используются в космической техники, оптических системах оптическом приборостроении, интегральной оптике, рентгеновской и нейтронной спектроскопии, электродинамике открытых систем, при создании преобразователей электромагнитного генераторов и И других излучений, в аппаратуре контроля загрязнения окружающей среды и т.д. В авторских свидетельствах [1 – 3] описаны просветляющие широкополосные оптические многослойные покрытия. Их авторы с помошью своих оптимизационных методик смогли получить неплохие результаты. Попробуем построить свою модель для оптических многослойных покрытий и с помощью r-алгоритма попытаемся немного улучшить спектральные характеристики этих покрытий.

Для расчета спектральных характеристик оптических многослойных покрытий будем использовать матричный метод [4].

Как известно [2], характеристическую матрицу одного слоя можно задать как:

$$M_{j}(N_{j},d_{j},\lambda) = \begin{vmatrix} \cos \delta_{j}(N_{j},d_{j},\lambda) & -\frac{i}{p_{j}} \sin \delta_{j}(N_{j},d_{j},\lambda) \\ -ip_{j} \sin \delta_{j}(N_{j},d_{j},\lambda) & \cos \delta_{j}(N_{j},d_{j},\lambda) \end{vmatrix}, \quad (1)$$

rge $\delta_{j}(N_{j},d_{j},\lambda) = \frac{2\pi N_{j}d_{j}\cos\theta_{j}}{\lambda}, \qquad N_{j} = n_{j}(1+ik_{j}), \quad i = \sqrt{-1},$

 $n_j, k_j, d_j, \theta_j, \lambda$ – показатель преломления, показатель поглощения, геометрическая толщина, угол между лучом, что падает на (j+1)-ый слой, и нормалью к плоскости разделения *j*-го и (j+1)-го слоев, длина волны соответственно.

Поскольку для уменьшения световых потерь в оптических элементах при просвещении их поверхностей используются материалы с незначительным поглощением, то будем считать для упрощения моделирования $k_j=0$ и, соответственно, $N_j=n_j$. При цьому значення $p_j = N_j \cos \theta_j$ для ТЕ хвилі (*s*-поляризація) і $p_j = \frac{N_j}{\cos \theta_j}$ для

ТМ хвилі (р-поляризація).

Рассмотрим случай, когда направление распространения излучения совпадает с нормалью к поверхности раздела отдельных слоев. Поэтому $\theta_i = 0$ и, соответственно, $p_i = N_i$.

Характеристическая матрица k-слойной структуры будет равна [4]:

$$M(\overline{n},\overline{d},\lambda) = M_k(n_k,d_k,\lambda) \cdot M_{k-1}(n_{k-1},d_{k-1},\lambda) \cdots M_2(n_2,d_2,\lambda) \cdot M_1(n_1,d_1,\lambda),$$
(2)

где M_j – характеристическая матрица *j*-ого слоя; $\overline{n} = (n_1, n_2, n_3, n_4)$ – вектор значений показателя преломления; $\overline{d} = (d_1, d_2, d_3, d_4)$ – вектор значений геометрической толщины; λ – длина волны.

Отсюда легко найти коэффициент пропускания k-слойной структуры при заданных значениях \overline{n} , \overline{d} та λ :

$$T(\bar{n},\bar{d},\lambda) = 1 - \left[\left| \frac{n_0(M_{11}(\bar{n},\bar{d},\lambda) + n_S \cdot M_{12}(\bar{n},\bar{d},\lambda)) - (n_S \cdot M_{22}(\bar{n},\bar{d},\lambda) + M_{21}(\bar{n},\bar{d},\lambda))}{n_0(M_{11}(\bar{n},\bar{d},\lambda) + n_S \cdot M_{12}(\bar{n},\bar{d},\lambda)) + (n_S \cdot M_{22}(\bar{n},\bar{d},\lambda) + M_{21}(\bar{n},\bar{d},\lambda))} \right|^2, (3)$$

где n_0 , n_s — показатели преломления внешней среды и подложки соответственно, M_{11} , M_{12} , M_{21} , M_{22} — элементы характеристической матрицы M.

Целевую функцию представим у виде:

$$\max_{\overline{n},\overline{d}} F(\overline{n},\overline{d}) = \left(\frac{1}{L} \sum_{i=1}^{L} T^2(\overline{n},\overline{d},\lambda_{(i)})\right)^{1/2}, \quad (4)$$

где L – число точек сетки спектрального интервала от λ_1 до λ_2 . При равномерном его делении с шагом $\Delta\lambda$

$$L = \frac{\lambda_2 - \lambda_1}{\Delta \lambda} + 1.$$

Способы вычисления производных из данной целевой функции описано в [5].

Рассмотрим авторское свидетельство [1]. Используя описанную выше модель и применяя г-алгоритм попробуем улучшить его спектральные характеристики. Оптимизация будет проводиться

только по геометрической толщине, значения показателей преломления зафиксируем. Рабочая длина волны рассматриваемого фильтра равна $\lambda_0 = 630$ нм.

После проведения оптимизации [6-10], получим оптимальные значения геометрической толщины, значение функционала $F(\bar{n}, \bar{d})$ при которых будет равно 0.997 (рис. 1, кривая 2). Значение функционала $F(\bar{n}, \bar{d})$ с параметрами, взятыми из авторского свидетельства [1], равно 0.995 (рис. 1, кривая 1).



Рис. 1. Кривые коэффициента пропускания при просветлении подложки с показателем преломления *n_s*=1.52:

1 – параметры взятые из авторского свидетельства №1083144 [1] 3.76· n_1d_1 =3.76· n_2d_2 =0.455· n_3d_3 = n_4d_4 =0.25· λ_0 , n_1 =2.0, n_2 =1.37, n_3 =2.0, n_4 =1.37;

2 - параметры полученные в этой работе

 $1.198 \cdot n_1 d_1 = 1.417 \cdot n_2 d_2 = 1.07 \cdot n_3 d_3 = 0.762 \cdot n_4 d_4 = 0.25 \cdot \lambda_0, n_1 = 1.7, n_2 = 1.45,$

Как видно с рис. 1, данный подход позволил улучшить просветление подложки по краям рассматриваемого диапазона. Но существующий провал для длин волн между 500 и 550 нм не позволяет заключить, что полученный фильтр в целом лучше предыдущего, а скорее наоборот.

Рассмотрим другие произведенные вычислительные эксперименты. Для этого рассмотрим авторские свидетельства [2-3]. Покажем, что, не изменяя значений показателей преломления слоев, несколько улучшить спектральные характеристики можно (рис. 2–3) просветления подложки за счет оптимизации геометрической толщины в рассматриваемой модели (1-4) используя r-алгоритм. Рабочая длина волны оптического фильтра [2] равна $\lambda_0 = 750$ нм, а для оптического фильтра [3] – $\lambda_0 = 630$ нм.



Рис. 2. Кривые коэффициента пропускания при просветлении 7слойной структурой с чередующимися слоями (1.35 та 2.1) подложки с показателем преломления *n_s*=1.52:

1 — параметры взятые из авторского свидетельства №934429 [2] (оптические толщины слоев относительно λ_0 становят 0.064 : 0.038 : 0.401 : 0.032 : 0.084 : 0.459 : 0.229);

2 — параметры полученные в этой работе (оптические толщины слоев относительно λ_0 становят 0.063 : 0.012 : 0.229 : 0.02 : 0.082 : 0.224 : 0.167).



Рис. 3. Кривые коэффициента пропускания при просветлении 7слойной структурой с чередующимися слоями (1.35 та 2.1) подложки с показателем преломления *n_s*=1.52:

1 — параметры взятые из авторского свидетельства №838629 [3] (оптические толщины слоев относительно λ_0 становят 0.06 : 0.02 : 0.35 : 0.02 : 0.07 : 0.42 : 0.21);

2 — параметры полученные в этой работе (оптические толщины слоев относительно λ_0 становят 0.038 : 0.035 : 0.047 : 0.126 : 0.014 : 0.059 : 0.155).

Рассмотрим значение функционала для каждого ИЗ рассмотренных оптических многослойных покрытий. Так, значение $F(\overline{n},\overline{d})$ с параметрами функционала взятыми с авторского свидетельства [2] на спектральном диапазоне 0.75 – 1.25 λ_0 становит 0.9982, а с параметрами полученными в данной роботе – 0.9996 (рис. конструкции. 2). Рассмотрим следующие Для спектрального диапазона 0.75 – 1.14 λ_0 значение функционала $F(\overline{n}, \overline{d})$ с параметрами взятыми с авторского свидетельства [3] становит 0.9974, а с параметрами полученными в данной роботе – 0.9989 (рис. 3). Даже увеличив спектральный диапазон до розмеров 0.6 – 1.14 λ_0 значение функционала $F(\bar{n}, \bar{d})$ с параметрами полученными в данной роботе практически не меняется, а для свидетельства [3] будет становить – 0.9889.

Полученные, после решения оптимизационной задачи (1–4) с помощью г-алгоритма, значения спектральных характеристик просветления подложки (рис.2, кривая 2) и (рис.3, кривая 2) есть несколько лучше, чем спектральных характеристик просветления подложки существующих оптических многослойных покрытий (рис.2, кривая 1) и (рис.3, кривая 1). Это позволяет утверждать, что галгоритм является эффективным инструментом решения некоторых оптимизационных задач, связанных с оптическими многослойными покрытиями.

Литература

- Просветляющее интерференционное покрытие: А.с. 1083144 СССР, МКИ G 02 B 5/28; G 02 B 1/10. // Б.И. Агафонов, М.Ф. Васильева, А.С. Герчиков, Е.А. Федин, П.П. Яковлев (СССР). – № 3420182/18– 10; Заявлено 12.04.82; Опубл. 30.03.84, Бюл. №12. – 3 с.
- Широкополосное просветляющее покрытие: А.с. 934429 СССР, МКИ G 02 B 5/28. // В.Д. Веденский и Е.Г. Столов (СССР). – № 2809841/18–10; Заявлено 09.07.79; Опубл. 07.06.82, Бюл. №21. –3 с.
- Интерференционное ахроматическое просветляющее покрытие: А.с. 838629 СССР, МКИ G 02 В 5/28. // В.Д. Веденский, Е.Г. Столов, А.А. Метельников, Ш.А. Фурман и Е.Г. Семин (СССР). – №2822915/18–10; Заявлено 15.10.79; Опубл.15.06.81,Бюл. №22.–3с.
- 4. Abeles F. Ann.de Physique. 1950. V.5. P. 596-640.
- 5. Стецюк П.И., Мица А.В. О задачах оптимизации параметров для многослойных оптических покрытий // Кибернетика и системный анализ. Киев, 2005. С. 107–115.
- Міца О.В. Синтез чотиришарових структур та аналіз ефективності методів багатовимірного пошуку // Наук. вісник Чернівецького унту. – Сер. матем. – 2002. – Вип. 150. – С. 63–68.

- Міца О.В. Оптимізація характеристик оптичних покрить на основі неоднорідних плівок з різним типом розподілу показника заломлення // Наук. вісник Ужгород. ун-ту. Сер. матем. і інф. – 2001. – Вип. 6. – ст. 95-99.
- 8. Mitsa, A., V. Mitsa, and A. Ugrin. "Modelling of spectral characteristics on inhomogeneous (gradient) antireflective coatings based on chalcogenide glasses. J." *Chalcogenide Letters* 2.1 (2005): 5-7.
- Mitsa, A. V., I. V. Fekeshgazi, and M. Gomes. "Modelling of Spectral Characteristics of Short-period Structures with Slightly Inhomogeneous Films Based on Wide Bandgap Optical Materials." Proc. 8th World Multiconference on Systemics, Cybernetics and Informatics (SCI 2004): Invited Session "Photonic Materials for Optical Computing ", Orlando, USA. 2004.
- 10. Міца О.В., Стецюк П.І. Задача знаходження оптимальних параметрів однорідного оптичного покриття // Теорія оптимальних рішень. № 2. Київ, 2003. С. 127–134.